

【説明内容】

◆環境チャレンジ目標について

持続可能な社会をめざして、環境チャレンジ宣言を当社の創立記念日2021年9月8日に宣言した。大きく2つあり、1つはカーボンニュートラル（以下、CN）、もう1つは産業廃棄物ゼロを目指す。

当社では1993年に環境ボランティアプランというCO₂を年率1~3%減らし、産業廃棄物をゼロにするという宣言をした。着実な活動により産業廃棄物に関して国内は“ゼロ”に近づきつつあり、今後も国内外のグループ含め積極的に活動を行っていく。

CNは、非常に高い目標となる。売上が増加するとCO₂は増える傾向にあるが、2030年にCO₂排出量50%減を達成するためには、年率5%程度の総量削減が必要となる。CNに向け、地球環境対策委員会という組織を活用し、工程表を作り、予算化し着実に取り組んでいく。

◆今後の成長事業について

当社は、半導体製造工程で使用されるエッチング装置、あるいはCVD（化学気相蒸着）装置に使用される部品のシャワーヘッド、冷却板、ヒーターを量産している。シリコンウエハーにエッチングで溝を掘る、回路を作る、あるいはCVD（化学気相蒸着）、ALD（原子層堆積）という装置で加熱しながら成膜する。この工程で使用される冷却板やヒーターを生産している。さらに、これらのプロセスに使う反応ガスを上から流すシャワーヘッドも生産している。これらはいずれも300mmから450mmぐらいの大きさで、中空構造になった複雑な形状をしており、機械加工だけでは作れない。また、これらは主にアルミニウムでできている。アルミニウムの板に溝等の複雑な加工をして複数枚重ね、「ろう付け」、「拡散接合」等の高度な接合技術で一体化させ、中空部分を作る。その後、高精度の機械加工を経て製品となる。

これらの製品は消耗品であり、新規品だけではなく、3ヶ月から1年で交換が必要となるため、交換需要が見込める製品である。

旺盛な需要に対応するため宮田工場も拡張を予定している。

この事業が有する「作る技術」は、独自技術であり、高い競争力をもって世界の大手半導体製造装置メーカー各社に採用が広がっている。半導体そのものの市場が大きく伸びていく中で、売上も拡大させていく。

以上